

Power MOSFET에서 Source voltage 저하에 관한 Failure analysis

정재성, 김종문, 이재혁, 하종신, 박상득
삼성전자 CS 경영센터 전문기술그룹

Failure analysis about deterioration of Source voltage in Power MOSFET

Jae-Seong Jeong, Jong-Moon Kim, Jae-Hyuk Lee, Jong-Shin Ha, Sang-Deuk Park
Advanced Technology Group, CS Management Center
Samsung Electronics
semi.jeong@samsung.com

Abstract

본 연구는 switching mode 의 Power NMOSFET failure mode 에 관하여 분석하고 원인을 규명하였다. 분석된 power NMOSFET 은 30V 급이며, vendor A 의 상용화 제품이다. 발생한 failure mode 는 power switch 회로에서 특정 ID 를 detect 하지 못하는 mode 였다. 측정결과 source voltage 가 저하되었으며, power NMOSFET DC 동작특성 분석 결과 V_{gs} 변화에 따라 Id 가 저하되었다. Fail 된 power MOSFET 특성값 reference 는 동일 LOT 의 양품을 선정하였다. De-cap 후 Inversion 과 Accumulation mode 별로 Photoemission spectrum analyzer(PSA) 분석 방법을 적용하였다. 결과 accumulation mode 에서 intensity 가 감소하였으며, forward diode mode 에서 국소적으로 변화하는 영역이 검출되었다. SEM 분석결과 gate metal 과 source metal 의 micro-contact 이 이루어져 있었다. 이 경우 gate metal 과 source metal 사이 close loop 를 형성하여 gate charge량을 변화시켜 power NMOSFET 의 출력을 저하하는 failure mode 가 발생됨을 분석할 수 있었다.

I. Introduction

일반적으로 Power Transistor 는 유니풀라와 바이폴

라로 종을 구분 지을 수 있다. 위에서 구분된 각 종을 더 세부적으로 나눈다면, 소자 동작에 기여하는 carrier(Majority 또는 Minority)를 조절하는 운영원이 전류와 전압이나를 기준으로 구분할 수 있다. 그 중 유니풀라 Power MOSFET 은 Power BJT 에 비해 스위칭 속도가 빠르고, 입력 임피던스가 높아 구동회로를 단순화 시킬 수 있어 컴퓨터, 가전시스템, 통신시스템등 다양한 곳에서 그 사용이 증가하고 있다.[6] MOSFET 도 그러했듯이 Power MOSFET 또한 최적화 성능을 얻기 위한 여러 가지 형태가 개발되었다. 예로 DMOS, groove MOS, HEXFET, SIPMOS, Trench MOS 등이 그 대표적인 예라 하겠다. 하지만 다양한 개념의 소자가 개발되고, 응용영역이 발생하면서 선형적으로 다양한 Failure mode 가 발생하게 되었다. 따라서 다양한 Failure mode 에 대하여 분석, 데이터를 축적함으로써 정확한 simulation 을 가능케 함으로써 소자 신뢰성 저하를 미연에 방지할 수 있도록 해야 한다.

본 연구에서는 Power NMOSFET 을 이용한 Power switch 회로에서 특정 ID 를 검출하지 못하는 Failure 에 대하여 분석을 수행하였다. Board 레벨에서 Failure mode 가 발견되지 않았으며, Power NMOSFET 의 source 전압 저하로 인한 IC 자체 결함으로 나타났다. Source 전압 저하 failure 를 유발한 Failure mode 를 찾기 위하여 다음과 같은 Failure analysis 를 수행하였다.

II. Experimental Setup

Failure analysis 를 위해 다음과 같은 분석장비를 적용하였다. DC 특성분석을 위해 Semiconductor Parametric Tester 인 Agilent 4155C 를 사용하였다. Leaky point 검출을 위해 Photoemission spectrum analyzer(PSA) 방법을 적용하였으며, Photoemission Microscopy 인 Hamamatsu PHEMOS Hot Electron Analyzer 를 사용하였다. 본 장비는 400nm~1100nm 의 wavelength 영역을 검출할 수 있다.[4] 그리고 Optical Microscopy 와 SEM(Scanning Electron Microscopy, Hitachi S3500N)을 사용하여 내부 defect 를 관찰하였다.

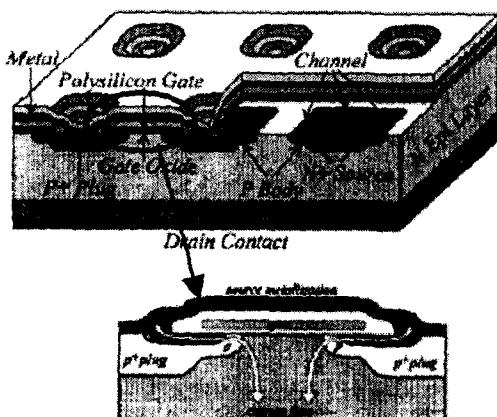


Fig. 1. Power MOSFET Basic Structure [J.H.Johnson & K.F.Galloway, IEEE NSREC Short Course, 1996]

실험에 적용된 Power NMOSFET 의 기본구조는 Fig. 1 과 같다. 전형적인 DMOSFET(Double Diffused Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 구조를 가지고 있으며, 30V 금 switch mode 의 상용화된 시료가 분석에 적용되었다. Vendor A 에서 제공된 specifications 는 다음과 같다. 상온에서 $V_{gs(th)}$ (Gate threshold voltage)는 1.0V; I_{gss} (Gate body Leakage)는 $\pm 100\text{nA}$; I_{dss} (Zero Gate Voltage Drain Current)는 V_{ds} (Source-Drain Voltage)가 24V 일 때 $2 \mu\text{A}$; $I_{d(on)}$ (On-state Drain Current)는 $V_{gs}=10\text{V}$, $V_{ds}=5\text{V}$ 일 때 20A ; 그리고 $r_{DS(on)}$ (drain-Source On-State resistance)는 $V_{gs}=5\text{V}$, $I_d=7\text{A}$ 일 때 0.04Ω 이다.

III. Results and Discussions

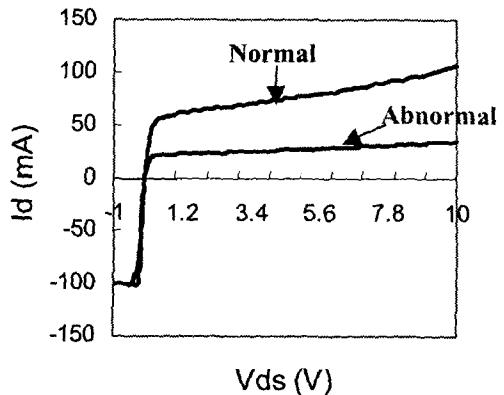


Fig. 2. Change of I_d according to V_{ds} of Normal Power NMOSFET and Abnormal Power NMOSFET ($@V_{gs}=2.1\text{V}$)

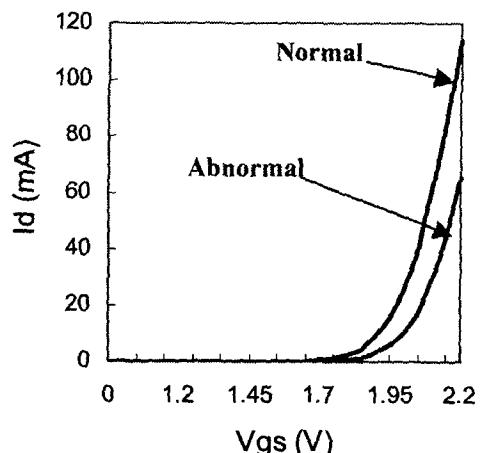


Fig. 3. Change of I_d according to V_{gs} of Normal Power NMOSFET and Abnormal Power NMOSFET ($@V_{ds}=3.0\text{V}$)

V_{ds} (Drain-Source voltage)를 3.0V 로 고정시키고 I_d - V_{gs} curve 를 측정했을 때 그림 3 과 같이 V_{th} (Threshold Voltage)가 불량시료에서 높게 측정되었다. V_{gs} 가 2.1V 일 때 양품시료와 불량시료의 I_d (Drain current) 차이는 43.6mA 였다. 앞에서 설명한 현상으로 동일 switching 전압을 인가했을 경우 V_{th} 가 높은 device 의 경우 channel resistance 가 상대적으로 크므로 Source 에 인가되는 전압은 저하된 전압이 걸리게 된다.

Source 전압 저하의 물리적 원인을 찾기 위하여

Photoemission spectrum analyzer(PSA) 방법을 적용하였다.

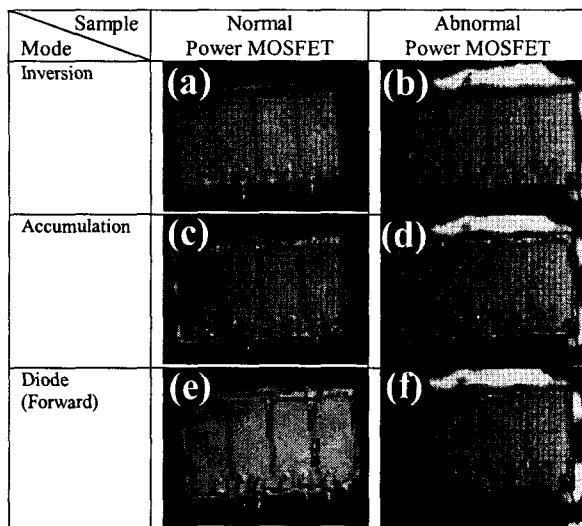


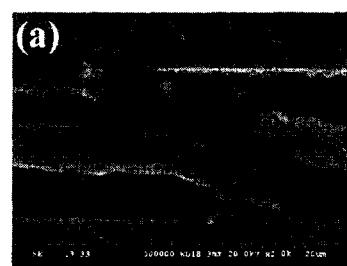
Fig. 4. Photoemission 2-D profile according to each mode
Power NMOSFET

Fig. 4(a)(b)에서 볼 수 있듯이 Inversion mode에서는 photoemission 이 검출되지 않았다. MOSFET 의 기본 동작원리로써, Channel 이 형성되고 device 가 동작하는 관점에서 양풀 및 불량 두 시료의 동작에는 차이가 없다고 말할 수 있다. 따라서 Gate oxide 의 손상에 의한 Threshold voltage 의 저하나 Hot-electron 에 의한 failure mode 가 아님을 예상할 수 있다.

Fig. 4(c)(d)와 같이 Accumulation mode에서 backside photoemission intensity 가 device 전체적으로 나타나지만, 불량시료의 경우 양풀시료에 비해 intensity 가 감소되었음을 볼 수 있다. 이는 channel mode(Source-Channel-Drain)인 MOSFET mode에서 전극전류로 흐르는 BJT mode(Source-P-body-Drain) 동작상태의 변화를 알 수 있다.

Gate 전압에 의한 surface charge 변수를 제거하기 위해 gate 전압을 인가하지 않고 diode 회로를 구성하였다. Forward bias 인가 시 Fig. 4(f)와 같이 불량시료에서 국부적으로 photoemission 이 검출이 되지 않는 부분이 발생되었다. Drain에서 p-body로 이동하는 electron 이 특정 위치에서 누설이 되고 있다고 예상할 수 있다.

Fig. 4(f)의 photoemission profile 을 기초로 하여 SEM 분석을 수행하였다.



Aluminum Ka1

Fig. 5. (a)SEM and (b)EDX picture

SEM 분석 결과 Fig. 5(a)에서 볼 수 있듯이 Gate metal과 Source metal 사이에 미세한 접합이 이루어 졌음을 볼 수 있다. 이는 Fig. 5(b)의 성분분석에서 알루미늄의 분포도를 통해 확인할 수 있다. 위 현상에 의해 source 와 gate metal 의 미세한 접합으로 인해 source 와 gate 간 ground potential 에 대한 reference 가 존재하지 못하게 된다. 그러므로 gate에 충분한 gate charge 가 형성 되지 못하게 됨으로써 정상적인 Threshold 전압을 발생하지 못하는 것이다. Threshold 전압의 저하는 저하된 Drain 전류를 형성하고, channel 저항은 커지며, 따라서 source에 인가되는 전압은 낮아지게 된다.

IV. Conclusions

수행된 연구는 Power NMOSFET 에 대한 Failure analysis 였다. Failure 현상은 Power switch에서 source 전압 저하에 의한 회로 내 specified ID 검출불량 이었다. 분석 결과, Failure Mode 는 gate 전극과 source 전극사이 미세 접합으로 인한 Ground potential 비정상 mode 에 의해 발생되었다.

Reference

- [1] T. Paul Chow "Chapter 7. High voltage SiC power devices".
- [2] Hubert Aigner, Kenneth Dierberger, and Denis Grafham "Improving the Full-bridge Phase-shift ZVT Converter for Failure-free Operation Under Extreme Conditions in Welding and Similar Applications" IAS 98.
- [3] K.S.Oh "MOSFET Basics" Fairchild Semiconductor. July 2000.
- [4] Jeong-Seon Seo, Sang-Sik Lee, Cheol-Su Choe, Ki-Dong Hong, Sabbas Daniel, Cheong-Ku Yoon "Intelligent Defect Localization Methodology through the use of Photoemission Spectral Analysis" 5th IPFA, pp49~54, 1995.
- [5] Takshi Ohzone, Naoko Matsuyama, Naomi Hosoi, Toshihiro Matsuda "An Analysis of Hot-Carrier-Induced Photoemission Profile in n-MOSFETs", ICMTS, Vol 11, pp211-215 March 1998.
- [6] 박일용, 최연일, 정상구, " 실리콘 전력 MOSFET 의 온도에 따른 항복전압 및 On 저항", 전기학회논문지, 49C, 4 호, 2000. 4